

非接触搬送を目的とした静電気浮上装置の提案

高知工科大学知能機械システム工学科
政木 慶次

1 . 緒言

1. 1 要旨

現在、あらゆる分野において使用されている機械的な支持機構は一般的に支持する対象物に接触し、その物の動きや位置などを制御している。このように従来の支持機構であれば当然、摩擦が生じるためクリーン度を要求する分野では機械的な接触のない支持機構が要求される。

本研究ではその中でも半導体工場での導入が考えられるシリコンウエハの動き、位置を能動的に非接触で制御するために、静電気をを用いた静電気浮上装置を提案する。